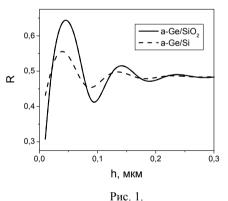
## ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ АМОРФНОГО ГЕРМАНИЯ НА КВАРЦЕВЫХ ПОДЛОЖКАХ

Студент гр.11311115 Альхимович М. А. Кандидат физ.-мат. наук, доцент Гацкевич Е. И. Белорусский национальный технический университет

Использование аморфных пленок германия на различных подложках находит широкое применение в оптоэлектронике при разработке светоизлучающих приборов. Ранее нами была просчитана отражательная способность R системы a-Ge/Si [1] на основе метода характеристических матриц. Этот же метод использован в настоящей работе для определения отражательной способности системы a-Ge/SiO<sub>2</sub>, где в качестве подложки используется кварцевое стекло. Известно, что в отличие от полупроводников, кварцевые стекла являются почти прозрачными в видимом диапазоне и характеризуются показателем преломления n=1.46. В расчете для комплексного показателя преломления a-Ge использовалось значение ñ=5.3+1.4i, для Si выбиралось ñ=3.76+0.015i. Оба значения соответствуют длине волны 694 нм, на которой работает рубиновый лазер, используемый



•

для лазерной модификации указанных систем. На рисунке приведены зависимости R от толщины плёнки h для обеих систем при нормальном падении света. Расчётные данные показывают, что амплитуда изменений R с изменением h выше для системы a-Ge/SiO<sub>2</sub>. Также наблюдается некоторое смещение максимумов

Работа выполнена при поддержке БРФФИ по проекту Ф16Р-069.

## Литература 1. Гацкевич, Е. И. Отражательная способно

1. Гацкевич, Е. И. Отражательная способность тонкопленочного германия на кремниевых подложках / Е. И. Гацкевич, М. А. Альхимович // Приборостроение — 2017: Материалы 10-й Международной научнотехнической конференции, 1-3 ноября 2017 года, Минск, Республика Беларусь. — Минск: БНТУ, 2017. — С. 359—360.